



- 超高温性能**
单炉体最高可达2000°C
- 大体积**
用于测试更大的样品
- 高精度，高灵活性**
悬挂对称式上天平，专为TGA设计
- 模块化设计，适应多种需求**
最高2000 °C: TGA, DTA, TG-DTA, TMA
最高1600 °C: DSC, TG-DSC
- TMA模块**
低负载的应用，可以更好地体现样品本身的性质
- 外部联用能力**
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	STA		TMA	
			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC		
温度范围(°C)		室温 ~ 2000	室温 ~ 2000	室温 ~ 1600	室温 ~ 2000	
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 20				
坩埚容积和最大样品尺寸		4.5 ~ 18.1 ml 或 高度: 80 直径: 20 mm, 不含坩埚	220 ~ 500 µl	360 ~ 420 µl	高度: 50 直径: 15mm	
气路	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC				
	腐蚀性气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC + 1路腐蚀性气体管道没有质量流量控制				
真空		初级真空 (< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选				
天平						
量程 (mg)	小	+/- 200				
	大	+/- 2 000				
最大样品量(g)		100				
天平分辨率(µg)		0.02				
DTA/DSC		DTA, TG-DTA		DSC, TG-DSC		
量热精度(%) ^{c,e}				+/- 2		
温度准确度(%) ^{c,e}				+/- 1		
TMA						
分辨率 (nm)						1.6
测量范围 (mm)						+/- 6

b. 氮气气氛下; c. 典型数据 e. 基于金属标准样品熔融; 参数可能会有变化

通过精心设计，THEMYS LV的悬挂式天平是极为可靠的，可适应较重样品的大幅质量变化。

系统的悬挂原理优化了气体与样品间的相互作用，使样品最大限度地接触环境气氛。

与THEMYS一样，THEMYS LV天平模块可以与一个用于热膨胀测量的垂直TMA模块相互切换。

多种气体控制选项:

- 配有智能软件的气路控制系统，可按程序来控制样品预处理或测试过程中切换气体种类，控制流量，改变气体混合比例；
- 真空操作及预处理选项；
- 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时，测试样品的反应活性。

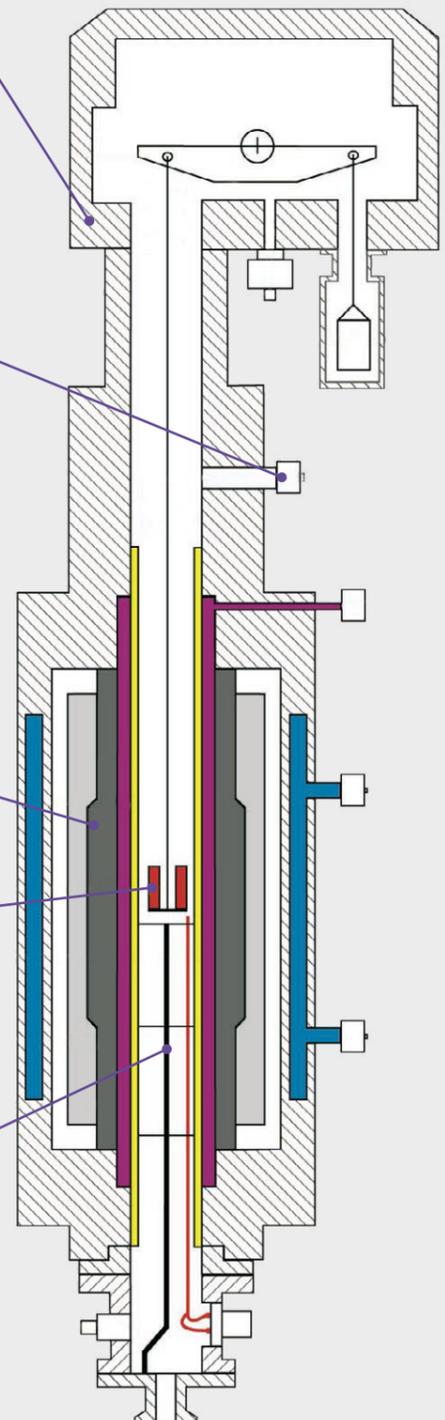
THEMYS LV的炉体是热分析仪市场上最大的。THEMYS LV具备较大均温区，可以对直径为20mm、高度80mm的样品进行高精度测试。

结合多种配置的单一石墨炉可以适应各种测试条件并提供多种热分析数据。

TGA, DTA, DSC配件:

- 从220 µl到18.1ml的陶瓷或金属坩埚
- TG挂丝或传感器
- DTA和DSC传感器测试温度分别达到1750°C和1600°C

配有高灵敏度热电偶的温度控制系统，以优化所有温区的精确控温要求。



THEMYS LV剖面示意图